科学研究費助成事業

_ . . _

研究成果報告書



研究成果の概要(和文):アモルファスゲルマニウムに含有される多量の点欠陥の集積化を利用して,ナノポー ラス構造の作製と制御を試みた.スパッタリングにより作製したa-GeをTEM中で一定速度で加熱すると500 で結 晶化した.粒径100nm程度の粗大粒子が生成し粒子間にはボイドネットワークが生成する.粒子の結晶構造は六 方晶である.一方,350 で数時間保持してから温度を上げると結晶化温度は600 に上がり立方晶ダイヤモンド 相が生成する.結晶粒径とナノ孔のサイズは数nmと微細である.アモルファスの初期構造が結晶化挙動を左右 し,それによりナノ孔の形成挙動が変化する.ナノ孔の制御にはアモルファス構造の制御が鍵を握る.

研究成果の概要(英文): An attempt to manipulate nanoporous (NP) structure of crystalline germanium films was made by using accumulation of amounts of point defects, which are intrinsically contained in amorphous Ge (a-Ge) films. When a-Ge films prepared by sputtering were annealed at a constant rate in TEM, they crystallized at 500. The microstructure is composed of coarse particles with the diameter of 100 nm and void network. The crystal structure is hexagonal. On the other hand, when a-Ge films were pre-annealed at 350 for a couple of hours and subsequently annealed at higher temperature, they crystallized at 600 to be the diamond cubic structure. The microstructure is composed of fine particles and isolated spherical voids, both with the diameter around 5 nm. NP structure is governed by the crystallization behavior of a-Ge, which varies from state to state of amorphous structure. The control of atomic-level structure of a-Ge is crucial to that of NP structure of crystalline germanium.

研究分野: 材料組織学

キーワード: アモルファスゲルマニウム 結晶化 ナノポーラス構造

1.研究開始当初の背景

リチウムイオン電池の負極材料にはグラ ファイト(C)が用いられているが,その性 能の上を行く代替材料のひとつに Ge が挙げ られる.高い電気容量(1623 mAh/g, Cの4 倍強)かつ高い Li の拡散性ゆえに待望され る材料でありながら,充放電サイクルでの Li の吸収・放出に伴う大きな体積変化が部材の 破壊や界面剥離の引き金となるためネック となっている、この難点の克服、すなわち、 体積変化に伴って発生する応力を緩和する ための方策は,材料の「ナノスケール化」と 「多孔質化」である.比表面積を増大させる 多孔質化は,電荷輸送を助長するため電極特 性を一層向上させる上でも有利に働く.以上 のような背景から,ナノポーラス Ge 薄膜の 創製は重要な研究トピックでありながらも、 報告例は限定的であり,新しい作製手法の開 発は遅れている.

2.研究の目的

本研究では a-Ge 薄膜の結晶化によるナノ ポーラス化機構の解明,および,ナノポーラ ス構造制御手法の確立をゴールに据えた基 礎研究を実施する.加熱および電子励起とい う2つのルートでの結晶化とそれに付随する ナノポーラス化を主に透過型電子顕微鏡 (TEM)を用いて詳細に調べ,ナノ孔構造制 御の原理を構築する.

3.研究の方法

(1) アモルファス薄膜の作製

高周波スパッタリング装置(現有設備)を 用いて NaCI 清浄へき開面上にアモルファス 膜(Ge, Si)を成膜する.基板温度(液体窒素 ~室温)および成膜速度をパラメータとする. NaCI を蒸留水に溶かし,分離した薄膜(膜厚: 20~40nm)を TEM 用の Mo メッシュですくい, これを平面観察試料とする.

(2) TEM 内でのその場加熱およびその場照射実験

Hitachi H-7000 型 TEM (阪大超高圧電顕セ ンター)を用いて,等時昇温実験を行う.高 性能 CCD カメラによる動画撮影も併用して詳 細なデータを取得する.

H-7000 型および JEOL 3000-F 型 TEM (阪大 産研)を使用する.前者を低電子エネルギー 領域 (25-125 keV),後者を高電子エネルギ ー領域 (125-300 keV)の実験用とする.a-Ge は低電子エネルギーでの電子励起により結 晶化すると予想される.そのことを立証する ために,広範な電子エネルギー範囲での実験 を行う.

(3) アモルファス構造の電子線動径分布解 析

H-7000 および 3000-F 型 TEM を用いて結晶 化までの電子回折像を Imaging Plate に撮影 して定量解析し,動径分布関数を求める. (1) ナノポーラス構造の形成

スパッタリング法で作製した a-Ge 薄膜に 125 keV の電子線を照射すると結晶化する. その結晶化組織は、作製後の経過時間、すな わち,室温時効によって変遷することが見出 された.図1は,室温時効の期間ごとに,ア モルファスから形成した結晶化組織の TEM 像 である,時効3日の試料では100 nm ほどの 粒径をもつ粗大粒子(暗い領域)が急速に生 成し,時効3ヶ月では粗大粒子と10 nm ほど のナノ結晶組織が共存する.時効7ヶ月では 均一で微細なナノ結晶組織となり,時効期間 に応じて系統的に変化する.粗大粒子が形成 するときは,粗大なナノ孔のネットワーク (明るい領域)が形成される.一方,微細な ナノ結晶が形成する場合は,孤立した微細な ナノ孔が分散する.

ナノ孔の形成挙動は結晶化挙動に支配される.結晶化組織の変遷は,アモルファス構造の変化を反映したものであるとの想定で アモルファスの構造解析を行った.その成果を(2)に記す.



図 1. アモルファスゲルマニウム薄膜を透過 型電子顕微鏡の中で電子線を照射して結晶化 させたときのミクロ組織.成膜後の経過時間 (a)3日,(b)3ヶ月,(c)7ヶ月.

(2) アモルファス構造の解析

上記の三つの時効試料に対して,二体分布 解析を行った結果を図2に示す.時効3日の 二体分布関数におけるメインピークは最大 強度となり,時効時間の経過に伴い強度は低

4.研究成果

下していく.さらに.時効7ヶ月の関数には, 0.32 nm 付近に新たなピーク成分が出現して いる.これらの結果は,作製直後のアモルフ ァス構造は規則性が高いこと,および,時効 により構造がよりランダムな方向へ変化す ること,を示す.分子動力学シミュレーショ ンによる解析を交えた結果,作製直後の薄膜 には4 配位構造を基本とする MRO (medium-range ordered,中範囲規則性)ク ラスターが存在し,室温時効によってMROク ラスターが崩壊して高密度で配位数の高い 液体的領域に遷移するという解釈が可能で ある.



図 2. 図 1 の試料に対応するアモルファス薄 膜の二体分布関数.

(3) 未知の結晶構造の出現

作製直後の試料から出現する粗大粒子の 結晶構造は立方晶ダイアモンド型ではなく 六方晶構造であることが明らかになった.一 方,10nm程度の微細なナノ結晶組織となり結 晶構造は安定相のダイアモンド構造であっ た.作製直後の薄膜に含まれる中距離規則構 造(1-2 nm級のクラスター)が六方晶構造の 結晶が生成することから,このクラスターは その結晶核の役割を担っている.その新しい 知見を強く示唆する成果が3年間の研究から 得られた.本研究課題から派生して,クラス ターの構造(原子配列)と六方晶結晶の詳細 な構造との関連性を調べる研究に着手して いる.

5.主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計3件) M. Okugawa, R. Nakamura, M. Ishimaru, K. Watanabe, H. Yasuda, H. Numakura, transition Structural in sputter-deposited amorphous germanium films by aging at ambient temperature, Journal of Applied Physics, 119, 214309.1-7, (2016)査読有 DOI: 10.1063/1.4953234 M. Okugawa, R. Nakamura, M. Ishimaru, Yasuda, Η. Numakura. Η. Crystallization of sputter-deposited amorphous Ge films by electron

irradiation: Effect of low-flux pre-irradiation, Journal of Applied Physics, 120, 134308.1-7 (2016) 査読 有

DOI: 10.1063/1.4964332

M. Okugawa, <u>R. Nakamura, M. Ishimaru</u>, H. Yasuda, H. Numakura, Thermal crystallization of sputter-deposited amorphous Ge films: Competition of diamond cubic and hexagonal phases, AIP Advances, 6, 125035.1-9 (2016) 査 読有

DOI: 10.1063/1.4972282

〔学会発表〕(計9件)

奥川将行,<u>仲村龍介</u>,沼倉宏,<u>石丸学</u>, 保田英洋,アモルファスゲルマニウムの 電子照射誘起結晶化とナノ孔形成,日本 金属学会 2014 年秋期講演大会,2014年9 月 25日,名古屋大学(愛知県名古屋市).

奥川将行,<u>仲村龍介</u>,沼倉宏,渡邉和輝, 石丸学,保田英洋,アモルファスゲルマ ニウムの電子照射誘起結晶化に伴う特異 な組織形成,日本金属学会2015年春期講 演大会,2015年3月19日,東京大学(東 京都).

奥川将行,<u>仲村龍介</u>,沼倉宏,<u>石丸学</u>, 保田英洋,アモルファスゲルマニウムに 潜む構造不均一性と加熱結晶化挙動の関 係,日本金属学会2015年秋期講演大会, 2015年9月17日,九州大学(福岡県福 岡市).

奥川将行,<u>仲村龍介</u>,沼倉宏,渡邉和輝, 石丸学,保田英洋,アモルファスゲルマ ニウムの構造不均一性と結晶化挙動,日 本鉄鋼協会・公益社団法人日本金属学会 関西支部材料物性工学談話会,2016年1 月27日,京都大学(京都府京都市).

奥川将行,<u>仲村龍介</u>,沼倉宏,<u>石丸学</u>, 保田英洋,単成分アモルファス物質にお ける構造不均一性とそれにまつわる二、 三の現象,日本材料学会金属ガラス部門 委員会,2016年5月12日,大阪府立大 学(大阪府堺市)

奥川将行,<u>仲村龍介</u>,沼倉宏,<u>石丸学</u>, 保田英洋, Structural transition in sputter-deposited amorphous germanium films by aging at ambient temperature: TEM analysis and MD simulation, 23rd International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (ISMANAM 2016), 2016年7月 4日,奈良春日野国際フォーラム(奈良 県奈良市) <u>仲村龍介,石丸学</u>,電子線二体分布解析 によるアモルファス - 結晶遷移過程の解 析と鉄鋼研究への適用,日本鉄鋼協会第 172回秋季講演大会,2016年9月22日, 大阪大学(大阪府豊中市)

奥川将行,<u>仲村龍介</u>,沼倉宏,<u>石丸学</u>, 保田英洋,アモルファスゲルマニウムの 結晶化による準安定結晶相の形成,日本 金属学会2016年秋期講演大会,2016年9 月22日,大阪大学(大阪府豊中市).

<u>仲村龍介</u>,奥川将行,沼倉宏,<u>石丸学</u>,保 田英洋,アモルファスゲルマニウム薄膜 の不均一な結晶化,第 64 回応用物理学会 春季学術講演会,2017 年 3 月 17 日,パ シフィコ横浜(神奈川県横浜市)

〔その他〕

ホームページ等

http://mtr1.osakafu-u.ac.jp/engm/member s/nakamura/

6.研究組織

(1)研究代表者
仲村 龍介(NAKAMURA, Ryusuke)
大阪府立大学・大学院工学研究科・准教授
研究者番号:70396513

(2)研究分担者

なし

(3)連携研究者
石丸 学(ISHIMARU, Manabu)
九州工業大学・大学院工学研究科・教授
研究者番号:00264086